

SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

B81 TECHNOLOGIE DES MICROSTRUCTURES

B81B DISPOSITIFS OU SYSTÈMES À MICROSTRUCTURE, p.ex. DISPOSITIFS MICROMÉCANIQUES (éléments piézo-électriques, électrostrictifs ou magnétostrictifs en soi H01L 41/00) [7]

Note(s) [7]

1. La présente sous-classe ne couvre pas:
 - les dispositifs purement électriques ou électroniques en soi qui sont couverts par la section H, p.ex. par la sous-classe H01L;
 - les dispositifs purement optiques en soi, qui sont couverts par les sous-classes G02B ou G02F;
 - les structures bidimensionnelles par essence, p.ex. les produits stratifiés qui sont couverts par la sous-classe B32B;
 - les structures chimiques ou biologiques en soi qui sont couvertes par la section C;
 - les structures à l'échelle atomique produites par la manipulation d'atomes ou de molécules un par un, qui sont couvertes par le groupe B82B 1/00.
2. Les dispositifs ou les systèmes classés dans la présente sous-classe sont également classés dans les sous-classes appropriées couvrant leurs caractéristiques de structure ou leurs caractéristiques fonctionnelles, si de telles caractéristiques présentent un intérêt.

1/00 Dispositifs sans éléments mobiles ou flexibles, p.ex. dispositifs capillaires microscopiques [7, 2006.01]

3/00 Dispositifs comportant des éléments flexibles ou déformables, p.ex. comportant des membranes ou des lamelles élastiques (B81B 5/00 a priorité) [7, 2006.01]

5/00 Dispositifs comportant des éléments mobiles les uns par rapport aux autres, p.ex. comportant des éléments coulissants ou rotatifs [7, 2006.01]

7/00 Systèmes à microstructure [7, 2006.01]

- 7/02 • comportant des dispositifs électriques ou optiques distincts dont la fonction a une importance particulière, p.ex. systèmes micro-électromécaniques (SMEM, MEMS) (B81B 7/04 a priorité) [7, 2006.01]
- 7/04 • Réseaux ou matrices de dispositifs à microstructure semblables [7, 2006.01]